

(11)Publication number:

2003-015175

(43) Date of publication of application: 15.01.2003

(51)Int.CI.

G02F 1/37

H01S 3/10

(21)Application number: 2001-341797

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

07.11.2001

(72)Inventor: YAMAMOTO SHUHEI

HIRANO YOSHIHITO

SHOJI ICHIRO HIRATO HIRONORI **KURIMURA SUNAO**

(30)Priority

Priority number : 2001131953

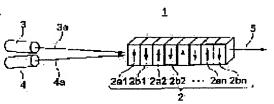
Priority date: 27.04.2001

Priority country: JP

(54) SOLID-STATE LIGHT SOURCE APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily and surely realize generation of a high power and highly efficient tera-hertz wave while maintaining a narrow line width characteristic. SOLUTION: This solid-state light source apparatus is provided with a 1st excitation laser light source 3 for outputting a 1st wavelength laser beam, a 2nd excitation laser light source 4 for outputting a 2nd wavelength laser light having a difference frequency in a tera-hertz band from the 1st wavelength laser light, and a semiconductor pseudo phase matching device 2 which is located at the overlapped place of the 1st optical axis of the 1st wavelength laser light and the 2nd optical axis of the 2nd wavelength laser light and generates tera-hertz light in a direction coaxial with the 1st and 2nd optical axes based on the irradiation of the 1st and 2nd wavelength laser light.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.06.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-15175 (P2003-15175A)

(43)公開日 平成15年1月15日(2003.1.15)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ		;	テーマコード(参考)
G 0 2 F	1/37		G 0 2 F	1/37		2K002
H01S	3/10		H01S	3/10	С	5 F O 7 2

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 8 頁)

(21)出願番号	特顧2001-341797(P2001-341797)	(71)出願人	000006013
			三菱電機株式会社
(22)出願日	平成13年11月7日(2001.11.7)		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
		(72)発明者	山本 修平
(31)優先権主張番号	特願2001-131953(P2001-131953)		東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
(32)優先日	平成13年4月27日(2001.4.27)		菱電機株式会社内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	平野 嘉仁
			東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三
			菱電機株式会社内
		(74)代理人	100057874
		(7.5) (4.5)	弁理士 曾我 道服 (外6名)
			万在工 自我 追照 U10石/
		1	

最終頁に続く

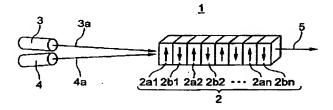
(54) 【発明の名称】 固体光源装置

(57)【要約】

【課題】 従来の各種の手法によるテラヘルツ光の発生では、低効率で出力パワーが小さかった。

【解決手段】 第1の波長のレーザ光を出力する第1の励起レーザ光源3と、前記第1の波長のレーザ光との差周波数がテラヘルツ帯である、第2の波長のレーザ光を出力する第2の励起レーザ光源4と、前記第1の波長のレーザ光の第1の光軸と前記第2の波長のレーザ光の第2の光軸がオーバーラップしている箇所に配置され、前記第1及び第2の波長のレーザ光の照射に基づいて前記第1及び第2の光軸と同軸な方向にテラヘルツ光を発生する半導体擬似位相整合素子2とを備えた。

【効果】 狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できる。



【特許請求の銃囲】

【請求項1】 第1の波長のレーザ光を出力する第1の 励起レーザ光源と、

前記第1の波長のレーザ光との差周波数がテラヘルツ帯である、第2の波長のレーザ光を出力する第2の励起レーザ光源と、

前記第1の波長のレーザ光の第1の光軸と前記第2の波 長のレーザ光の第2の光軸がオーバーラップしている箇 所に配置され、前記第1及び第2の波長のレーザ光の照 射に基づいて前記第1及び第2の光軸と同軸な方向にテ ラヘルツ光を発生する非線形波長変換素子とを備えたこ とを特徴とする固体光源装置。

【請求項2】 前記第1の励起レーザ光源は、波長固定レーザであり、

前記第2の励起レーザ光源は、波長可変レーザであることを特徴とする請求項1記載の固体光源装置。

【請求項3】 前記第1の励起レーザ光源は、Nd:YAGレーザであり、

前記第2の励起レーザ光源は、Yb:YAGレーザであることを特徴とする請求項2記載の固体光源装置。

【請求項4】 前記第1の励起レーザ光源は、前記第1 の波長が1.064μmの単色光であり、

前記第2の励起レーザ光源は、前記第2の波長が1μm 帯の単色光であることを特徴とする請求項3記載の固体 光源装置。

【請求項5】 前記第1及び第2の励起レーザ光源は、 Yb:YAGレーザであることを特徴とする請求項1記 載の固体光源装置。

【請求項6】 前記第1の励起レーザ光源は、Nd:Y LFレーザであり、

前記第2の励起レーザ光源は、Yb:YAGレーザであることを特徴とする請求項1記載の固体光源装置。

【請求項7】 前記非線形波長変換素子は、前記第1及び第2の光軸と同軸な方向の長さが各々 $\Lambda/2$ の複数個の第1の半導体材料と、長さが各々 $\Lambda/2$ の複数個の第2の半導体材料を拡散接合で一体とし、前記第1及び第2の半導体材料が前記第1及び第2の光軸と垂直な方向が[001]軸であり、それぞれの[001]軸の向きが平行で、かつ、[001]軸の向きが交互に逆になるように配置された半導体擬似位相整合素子であることを特徴とする請求項1記載の固体光源装置。

【請求項8】 前記半導体擬似位相整合素子の前記第1 及び第2の半導体材料は、テラヘルツ領域で透明な材料 であることを特徴とする請求項7記載の固体光源装置。

【請求項9】 前記半導体擬似位相整合素子の前記第1 及び第2の半導体材料は、GaPであることを特徴とする請求項8記載の固体光源装置。

【請求項10】 前記半導体擬似位相整合素子の前記第 1及び第2の半導体材料は、GaAsであることを特徴 とする請求項8記載の固体光源装置。 【請求項11】 前記非線形波長変換素子は、前記第1及び第2の光軸と同軸な方向の長さが各々 Λ /2の複数個の第1の半導体材料と、長さが各々 Λ /2の複数個の第2の半導体材料を拡散接合で一体とし、前記第1及び第2の半導体材料の方位が、前記第1及び第2の光軸に垂直な方向に同一で、かつ、向きが交互に逆になるように配置された半導体疑似位相整合素子であることを特徴とする請求項1記載の固体光源装置。

【請求項12】 前記半導体擬似位相整合素子の前記第 10 1及び第2の半導体材料は、テラヘルツ領域で透明な材料であることを特徴とする請求項11記載の固体光源装置。

【請求項13】 前記半導体擬似位相整合素子の前記第 1及び第2の半導体材料は、GaPであることを特徴と する請求項12記載の固体光源装置。

【請求項14】 前記半導体擬似位相整合素子の前記第 1及び第2の半導体材料は、GaAsであることを特徴 とする請求項12記載の固体光源装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

20

30

【発明の属する技術分野】この発明は、固体光源装置に関し、さらに詳しくは、テラヘルツ帯分光用光源、イメージング光源、通信さらには計測用光源に用いる固体光源装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】テラヘルツ帯を発生する光源としては、GaAs光伝導素子、磁場印加型半導体素子、LiNbO3を用いた光パラメトリック発振器、あるいは有機非線形光学結晶を用いた差周波発生素子などがあったが、いずれも低効率で出力パワーが小さかった。

【0003】また、従来の拡散接合を用いた半導体擬似位相整合素子は、接合界面での散乱が大きいために実用化には遠く及ばず、ましてやこの技術を用いたテラヘルツ光源は皆無であった。

【0004】従来の固体光源装置について図面を参照しながら説明する。図5は、例えば「レーザ研究、第26巻、第7号、p.515~521、1998年7月」に示された従来の固体光源装置の構成を示す図である。この図5は、テラヘルツ波発生に用いられている光伝導素子の一例の構成図である。

【0005】図5において、100は光伝導素子、101は半導体基板、102は光伝導薄膜、103は平行伝送線路、104はダイポールアンテナ、105はギャップ、106は直流電源、110は光パルス、111はテラヘルツ電磁波である。

【0006】この光伝導素子100では、GaAsなど 高速応答する半導体の基板101と、低温成長GaAs などの光伝導薄膜102上に、伝送線路103a及び1 03bからなる平行伝送線路103が形成され、その中 50 央部分に微少ダイポールアンテナ104からなる単一の 光スイッチが設けられている。

【0007】この光スイッチ104の中央には、例えば 数μm程度の微少なギャップ105があり、ギャップ1 05には直流電源106によって適当な電圧が印加され る。

【0008】このギャップ105間に半導体のバンドギ ャップよりも高いエネルギーのレーザ光が光パルス11 0として入射すると、半導体中に自由キャリアが生成さ れてパルス状の電流が流れ、このパルス状の電流の時間 微分に比例したテラヘルツ電磁波111が発生される。

【0009】このため、テラヘルツ電磁波111は、パ ルス状の電流が例えばピコ秒以下程度で発生し、さらに は、光パルス110がピコ秒以下程度の短パルスレーザ 光を照射することで発生する。

【0010】また、「レーザー学会学術講演会第17回 年次大会、23aII4、p. 194~197」に示さ れるように、光伝導素子上で、2つの連続波レーザを光 混合することにより、テラヘルツ波を連続発生させるこ とができる。周波数の異なる2つの単色光を混合する と、合成振幅は差周波数で変調される。その混合波 (光 20 ビート)を光伝導素子に照射すると、光電流が変調さ れ、アンテナから差周波数に対応した電磁波が放射され る。このため、差周波数がテラヘルツ程度となるように 2つの連続波レーザの周波数を取ることで、テラヘルツ 波が発生する。

【0011】また、「レーザ研究、第26巻、第7号、 p. 527~530、1998年7月」に示されるよう に、磁場中に置かれたInAs、GaAsなどの半導体 に、レーザ光としてピコ秒以下程度の光パルスを照射す ることで、テラヘルツ波を発生させることができる。

【0012】また、「レーザ研究、第26巻、第7号、 p. 522~526、1998年7月」に示されるよう に、2次の非線形光学効果を有する結晶としてLiNb O3を用い、結晶に光波を入射し、位相整合条件化で光 パラメトリック共振器を構成することで、テラヘルツ光 を発生させることができる。

[0013] tt. [OPTICS LETTERS, Vol. 25, No. 23, pp. 1714-171 6,2000」に示されるように、2次の非線形光学効 果を有する結晶として非線形性の高い有機結晶を用い、 結晶に差周波数がテラヘルツとなる2つのレーザを入射 し、位相整合条件化で差周波発生を行うことでテラヘル ツ光を発生させることができる。

【0014】さらに、「第61回応用物理学会学術講演 会 講演予稿集、No. 3, 4a-L-8, p957, 2000」に示されるように、2次の非線形光学効果を 有する材料としてバルク型の半導体材料を用い、非線形 材料に差周波数がテラヘルツとなる2つのレーザを入射 し、位相整合条件化で差周波発生を行うことでテラヘル ツ光を発生させることができる。

[0015]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来技術は、以下のような問題点があった。

【0016】短パルスレーザ光励起による光伝導案子で のテラヘルツ光の発生では、低効率で出力パワーが小さ かった。また、線幅が広いため単一縦モードの光源も存 在しなかった。

【0017】また、2つの連続波レーザ励起による光伝 導素子でのテラヘルツ光の発生では、低効率で出力パワ ーが小さかった。

【0018】また、短パルスレーザ光励起による磁場中 に置かれ半導体素子によるテラヘルツ光の発生では、低 効率で出力パワーが小さかった。また、線幅が広いため 単一縦モードの光源も存在しなかった。

【0019】また、非線形光学素子としてLiNbO3 を用いた光パラメトリック発振器によるテラヘルツ光の 発生では、LiNbO3におけるテラヘルツ光の吸収が 大きく、発生したテラヘルツ光の取り出し効率が低く、 出力パワーが小さかった。また、テラヘルツ光の出力角 度が励起光の光軸と一致していないため、光パラメトリ ック発振器において、励起光と波長変換により得られた テラヘルツ光の相互作用長を長く取ることが困難であ り、波長変換が低効率で出力パワーが小さかった。

【0020】また、非線形光学素子として有機結晶を用 いた差周波によるテラヘルツ光の発生では、低効率で出 カパワーが小さかった。

【0021】また、線形光学素子としてバルク型の半導 体材料を用いた差周波によるテラヘルツ光の発生では、 位相整合条件を長距離取ることが困難であるため、低効 率で出力パワーが小さかった。

【0022】さらに、従来の拡散接合を用いた半導体擬 似位相整合素子は、接合界面での散乱が大きいために実 用化には遠く及ばず、ましてやこの技術を用いたテラへ ルツ光源は皆無であるという問題点もあった。

【0023】この発明は、前述した問題点を解決するた めになされたもので、テラヘルツ波を発生するのに、半 導体の拡散接合による擬似位相整合差周波発生素子を用 いる。GaP、GaAsなどの半導体は、非線形光学定 数が大きいので高効率波長変換に適しており、テラヘル ツ領域で透明である。また、熱伝導率が大きく、高出力 動作にも適している。さらに、差周波光源として1 µm 帯の波長可変レーザを用いると、擬似位相整合差周波発 生によりテラヘルツ波を発生するための拡散接合周期 は、数mmと非常に長く、接合界面の数を最小限に抑え ることができるので、低損失の素子を作製することが可 能である。また、素子温度を調整し、差周波光源の一方 の波長をnmオーダーとわずかに変化させるだけで、テ ラヘルツ発生波長を数百μmにもわたってチューニング することが可能となるテラヘルツ波光源を提供すること 50 を目的とする。

30

40

[0024]

【課題を解決するための手段】この発明の請求項1に係る固体光源装置は、第1の波長のレーザ光を出力する第1の励起レーザ光源と、前記第1の波長のレーザ光との差周波数がテラヘルツ帯である、第2の波長のレーザ光を出力する第2の励起レーザ光源と、前記第1の波長のレーザ光の第1の光軸と前記第2の波長のレーザ光の第2の光軸がオーバーラップしている箇所に配置され、前記第1及び第2の波長のレーザ光の照射に基づいて前記第1及び第2の光軸と同軸な方向にテラヘルツ光を発生10する非線形波長変換素子とを備えたものである。

【0025】この発明の請求項2に係る固体光源装置は、前記第1の励起レーザ光源を、波長固定レーザとし、前記第2の励起レーザ光源を、波長可変レーザとしたものである。

【0026】この発明の請求項3に係る固体光源装置は、前記第1の励起レーザ光源を、Nd:YAGレーザとし、前記第2の励起レーザ光源を、Yb:YAGレーザとしたものである。

【0027】この発明の請求項4に係る固体光源装置は、前記第1の励起レーザ光源を、前記第1の波長が 1.064μ mの単色光とし、前記第2の励起レーザ光源を、前記第2の波長が 1μ m帯の単色光としたものである。

【0028】この発明の請求項5に係る固体光源装置は、前記第1及び第2の励起レーザ光源を、Yb:YAGレーザとしたものである。

【0029】この発明の請求項6に係る固体光源装置は、前記第1の励起レーザ光源を、Nd:YLFレーザとし、前記第2の励起レーザ光源を、Yb:YAGレーザとしたものである。

【0030】この発明の請求項7に係る固体光源装置は、前記非線形波長変換素子を、前記第1及び第2の光軸と同軸な方向の長さが各々 A/2の複数個の第1の半導体材料と、長さが各々 A/2の複数個の第2の半導体材料を拡散接合で一体とし、前記第1及び第2の半導体材料が前記第1及び第2の光軸と垂直な方向が [001] 軸であり、それぞれの [001] 軸の向きが平行で、かつ、 [001] 軸の向きが交互に逆になるように配置された半導体擬似位相整合素子としたものである。

【0031】この発明の請求項8に係る固体光源装置は、請求項7において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、テラヘルツ領域で透明な材料としたものである。

【0032】この発明の請求項9に係る固体光源装置は、請求項8において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、GaPとしたものである。

【0033】この発明の請求項10に係る固体光源装置 する波長可変レーザである。なお、第1のレーザ光源は、請求項8において、前記半導体擬似位相整合素子の 50 は、Nd原子の4F3/2から4I11/2の遷移の

6 前記第1及び第2の半導体材料を、GaAsとしたもの である。

【0034】この発明の請求項11に係る固体光源装置は、前記非線形波長変換素子を、前記第1及び第2の光軸と同軸な方向の長さが各々 A/2の複数個の第1の半導体材料と、長さが各々 A/2の複数個の第2の半導体材料を拡散接合で一体とし、前記第1及び第2の半導体材料の方位が、前記第1及び第2の光軸に垂直な方向に同一で、かつ、向きが交互に逆になるように配置された半導体疑似位相整合素子としたものである。

【0035】この発明の請求項12に係る固体光源装置は、請求項11において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、テラヘルツ領域で透明な材料としたものである。

【0036】この発明の請求項13に係る固体光源装置は、請求項12において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、GaPとしたものである。

【0037】この発明の請求項14に係る固体光源装置 は、請求項12において、前記半導体擬似位相整合素子 の前記第1及び第2の半導体材料を、GaAsとしたも のである。

[0038]

【発明の実施の形態】実施の形態1.この発明の実施の形態1に係る固体光源装置について図面を参照しながら説明する。図1は、この発明の実施の形態1に係る固体光源装置の構成を示す図である。この図1は、擬似位相整合非線形波長変換を用いたテラヘルツ波光源である固体光源装置の構成例である。

【0039】図1において、1は擬似位相整合非線形波 長変換を用いたテラヘルツ波光源である固体光源装置、 2は非線形波長変換素子である半導体擬似位相整合素 子、3は第1の励起レーザ光源、3aは波長21のレー ザ光、4は第2の励起レーザ光源、4aは波長22のレーザ光、5は波長23のテラヘルツ光である。

【0040】つぎに、この実施の形態1に係る固体光源 装置の動作について図面を参照しながら説明する。

【0041】第1の励起レーザ光源3は、波長λ1のレーザ光3aを出力し、第2の励起レーザ光源4は、波長 λ2のレーザ光4aを出力する。第1のレーザ光源3 は、Nd:YAGレーザであってもよく、第2のレーザ光源4は、Yb:YAGレーザであってもよい。

【0042】このため、第1の励起レーザ光源3は、レーザ光3aの波長λ1が1.064μmの単色光で出力する波長固定レーザである。Yb:YAGレーザは、1μm帯に広帯域な利得を有するため波長可変レーザとして構成することが可能であり、第2の励起レーザ光源4は、レーザ光4aの波長λ2が1μm帯の単色光で出力する波長可変レーザである。なお、第1のレーザ光源3は、Nd原子の4F3/2から4I11/2の悪路のは、Nd原子の4F3/2から4I11/2の悪路の

7

内、R2からY3の遷移を利用しているため発振波長が 1.064μmの波長固定レーザとなるが、他の遷移を 利用して他の発振波長で出力する波長固定レーザとして 用いてもよい。

【0043】第1の励起レーザ光源3からのレーザ光3 a、および、第2の励起レーザ光源4からのレーザ光4 aは、共に半導体擬似位相整合素子2に照射される。レーザ光3aとレーザ光4aの光軸は同軸に配置することが望ましいが、第1の励起レーザ光源3および第2の励起レーザ光源4の大きさの関係から僅かに角度をもっていてもよい。ただし、この場合、レーザ光3aとレーザ光4aの光軸は、半導体擬似位相整合素子2上では、ほぼ一致している。また、適切な光学部品を用いてレーザ光3aとレーザ光4aの光軸を前もって一致させておいてもよい。.

【0044】半導体擬似位相整合素子2は、励起光の光軸と同軸な方向の長さが Λ / 2の複数個の半導体材料2 an (n=1, 2, ・・・, n)、2bn (n=1, 2, ・・・, n)を拡散接合で一体としている。前記第 1及び第2の半導体材料の方位は、前記第1及び第2の 20 光軸に垂直な方向に同一で、かつ、向きが交互に逆になるように配置される。ここで、前記第1及び第2の半導*

 $\omega 1 - \omega 2 = \omega 3$, $\omega = c / \lambda$

ここで、ωは周波数、cは光速、λは波長である。

【0048】図2は、非線形波長変換素子でのレーザ光の伝搬長に対する波長変換光強度を示す模式図である。

【0049】2波長の励起レーザ光と差周波光の波数差※

$$\Delta k = k 1 - k 2 - k 3$$
, $k = 2 \pi n / \lambda$

[0051]

 $1 c = 2 \pi / \Delta k$

[0052] $\Lambda = 21c = 2\pi/\Delta k$

【0053】ここで、nは非線形波長変換素子の波長λに対する屈折率である。

【0054】バルク型の1素子による非線形波長変換素子を用いた場合、波長変換光強度は伝搬長が1cの時、飽和し最大となり、その後低下する。伝搬長が2lcの時、波長変換光強度は0となるが、伝搬長が3lcまで再び増加する。このように波長変換光強度は、増減を繰り返しながら非線形波長変換素子を伝搬するため、大きな出力光を得ることは困難である。

【0055】一方、非線形波長変換素子の分極方向をコヒーレンス長1c毎に反転させた疑似位相整合素子2の場合、伝搬長1c毎に増減を繰り返すことなしに、波長変換光強度を増加させることができる。

【0056】例えば、LiNbO3の場合、コヒーレン 合、差 ス長1c毎に分極方向を反転させた疑似位相整合波長変 励起対 換素子を作成する場合、LiNbO3に強電界をかける ひとで作成することもできる。一方、GaP、GaAs 【00をどの半導体材料の場合、強電界を用いた疑似位相整合 mのと 波長変換素子の作成が困難であるため、コヒーレンス長 50 ある。

*体材料の方位が、前記第1及び第2の光軸に垂直な方向が [001] 軸であり、それぞれの [001] 軸の向きが平行で、さらに、 [001] 軸の向きが交互に逆になるように配置されている場合、半導体材料における非線形光学定数は最も大きくとることができる。このため、ここでは前記第1及び第2の光軸に垂直な方向が [001] 軸である場合について示す。

【0045】第1の励起レーザ光源3からのレーザ光3 a、および、第2の励起レーザ光源4からのレーザ光4 a は、共に直線偏光である。レーザ光3 a の波長がレーザ光4 a の波長よりも短い場合、レーザ光3 a の偏光方向は半導体材料の[001]軸の向きと平行であり、レーザ光4 a の偏光方向は[001]軸の向きと垂直である。また、レーザ光3 a の波長がレーザ光4 a の波長よりも長い場合、レーザ光3 a の偏光方向は[001]軸の向きと垂直であり、レーザ光4 a の偏光方向は[001]軸の向きと垂直である。

【0046】2波長の励起レーザ光と非線形波長変換素子を用いた差周波発生を行う場合、以下の関係式が成り立つ。

[0047]

(1)

※を Δ k、コヒーレンス長を1c、反転周期を Λ としたとき、以下の関係が成り立つ。

[0050]

(2)

(3)

1 c 毎に切り分けた複数の半導体材料を用いて、拡散接合により一体化することで作成することができる。しかし、拡散接合による境界面は、完全に一体化することが困難であるため、特に境界面の数が多い場合、接合による損失が大きくなり、高出力な波長変換光を得ることは困難である。

【0057】図3は、GaPの屈折率の波長依存性を示す特性図である。

【0058】 1μ m帯近傍では、GaP の屈折率は単調 減少する。また、 25μ m帯に赤外異常分散が存在する。このような異常分散特性のため、長波長の方が短波 長より大きく屈折し、さらに、テラヘルツ近傍では屈折率は漸近し、ほぼ一定となる。

【0059】GaP、GaAsなどの半導体材料の場合、差周波がテラヘルツ程度となる1μm帯の2波長の励起光において、波数差はテラヘルツ光の波数にほぼ一致する。

【0060】図4は、差周波光の波長が $13=300\mu$ mのときの、コヒーレンス長1cの計算結果を示す図である。

【0061】ここで、横軸は励起光1の波長 11であ り、縦軸にコヒーレンス長 1 c を示している。励起光源 として1μm帯の2波長のレーザを用い、GaPなどの 半導体材料を波長変換素子として用い、テラヘルツ波帯 の差周波発生を行った場合、Δkが小さくなり、この結 果、コヒーレンス長lcはmmオーダーと長く取ること が可能である。従って、半導体擬似位相整合素子の接合 界面の数を最小限に抑えることができるので、低損失の 素子を作製することが可能であり、高効率で高出力のテ ラヘルツ光を得ることができる。

【0062】GaP、GaAsなどの半導体は、非線形 光学定数が大きいため高効率波長変換に適している。ま た、コヒーレンス長毎に [001] 軸の向きが交互にな るように接合した疑似位相整合波長変換素子であるた め、 $\Delta k = 0$ とする必要がなく、この結果、2波長の励 起光と差周波光の光軸は一致させることが可能である。 このため、2波長の励起光と差周波光の相互作用長を長 く取ることが可能であるため、特に高効率波長変換に適 している。

【0063】このような半導体擬似位相整合素子2と2 波長の励起光を用いた差周波発生では、特に高効率波長 変換が可能であるため、2波長の励起光は連続波からピ コ秒以下の短パルスまで様々なパルス長を用いてもテラ ヘルツ光の発生は高効率で高出力で得ることができる。 このため、2波長の励起光のパルス長を選択すること で、差周波のテラヘルツ光として連続波からピコ秒以下 の短パルスを得ることができる。このように、テラヘル ツ光の発生は、特にピコ秒以下の短パルスである必要が ないため、フーリエ限界で決定されるテラヘルツ光の波 長広がりを狭くすることが可能であり、狭線幅特性を維 30 持しつつ単一縦モードのテラヘルツ光を得ることができ

【0064】また、GaP、GaAsなどの半導体はテ ラヘルツ領域で透明であるため、差周波発生により得ら れたテラヘルツ光は吸収により減衰することがなく、高 効率に出力光として取り出すことが可能である。さら に、GaP、GaAsなどの半導体は熱伝導率が大きい ため、高出力動作にも適している。

【0065】また、素子温度を調整し、差周波光源の一 方の波長をnmオーダーとわずかに変化させるだけで、 テラヘルツ発生波長を数百μmにもわたってチューニン グすることが可能となるテラヘルツ波光源を提供するこ とができる。

【0066】なお、上記実施の形態では、非線形材料と してGaPを用いたが、GaAsなどの他の半導体も同 様な異常分散特性を有するため使用することができる。 【0067】また、上記実施の形態では、励起光源とし て、波長固定レーザにNd: YAGレーザを、波長可変 レーザにYb:YAGレーザを用いたが、Yb:YAG レーザを2台用いても実現可能であり、さらに他のNd 添加レーザ、Yb添加レーザを用いる場合にも適用可能

【0068】さらに、上記実施の形態では、励起光源と して、波長固定レーザにNd:YAGレーザを、波長可 変レーザにYb:YAGレーザを用いたが、波長固定レ ーザにNd:YLFレーザを、波長可変レーザにYb: YAGレーザを用いても実現可能であり、さらに他のN d添加レーザ、Yb添加レーザを用いる場合にも適用可 能である。

【0069】以上のように、この発明によれば、テラヘ 10 ルツ波発生に、1μm帯の波長可変レーザと大きな非線 形光学定数・熱伝導率を有する半導体の異常分散特性を 併用することで擬似位相整合差周波発生のための接合間 隔を数mmと長周期にする手法を提案したため、狭線幅 特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生 を容易かつ確実に実現できる。

[0070]

20

【発明の効果】この発明の請求項1に係る固体光源装置 は、以上説明したとおり、第1の波長のレーザ光を出力 する第1の励起レーザ光源と、前記第1の波長のレーザ 光との差周波数がテラヘルツ帯である、第2の波長のレ ーザ光を出力する第2の励起レーザ光源と、前記第1の 波長のレーザ光の第1の光軸と前記第2の波長のレーザ 光の第2の光軸がオーバーラップしている箇所に配置さ れ、前記第1及び第2の波長のレーザ光の照射に基づい て前記第1及び第2の光軸と同軸な方向にテラヘルツ光 を発生する非線形波長変換素子とを備えたので、狭線幅 特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生 を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0071】この発明の請求項2に係る固体光源装置 は、以上説明したとおり、前記第1の励起レーザ光源 を、波長固定レーザとし、前記第2の励起レーザ光源 を、波長可変レーザとしたので、狭線幅特性を維持しつ つ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実 に実現できるという効果を奏する。

【0072】この発明の請求項3に係る固体光源装置 は、以上説明したとおり、前記第1の励起レーザ光源 を、Nd:YAGレーザとし、前記第2の励起レーザ光 源を、Yb: YAGレーザとしたので、狭線幅特性を維 持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易か つ確実に実現できるという効果を奏する。

【0073】この発明の請求項4に係る固体光源装置 は、以上説明したとおり、前記第1の励起レーザ光源 を、前記第1の波長が1.064μmの単色光とし、前 記第2の励起レーザ光源を、前記第2の波長が1μm帯 の単色光としたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力か つ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現でき るという効果を奏する。

【0074】この発明の請求項5に係る固体光源装置 50 は、以上説明したとおり、前記第1及び第2の励起レー

ザ光源を、Yb: YAGレーザとしたので、狭線幅特性 を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容 易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0075】この発明の請求項6に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、前記第1の励起レーザ光源を、Nd:YLFレーザとし、前記第2の励起レーザ光源を、Yb:YAGレーザとしたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0076】この発明の請求項7に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、前記非線形波長変換素子を、前記第1及び第2の光軸と同軸な方向の長さが各々 A/2の複数個の第1の半導体材料を拡散接合で一体とし、前記第1及び第2の半導体材料が前記第1及び第2の光軸と垂直な方向が[001]軸であり、それぞれの[001]軸の向きが平行で、かつ、[001]軸の向きが交互に逆になるように配置された半導体擬似位相整合素子としたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0077】この発明の請求項8に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、請求項7において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、テラヘルツ領域で透明な材料としたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0078】この発明の請求項9に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、請求項8において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、GaPとしたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0079】この発明の請求項10に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、請求項8において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、GaAsとしたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0080】この発明の請求項11に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、前記非線形波長変換素子を、

前記第1及び第2の光軸と同軸な方向の長さが各々 Λ /2の複数個の第1の半導体材料と、長さが各々 Λ /2の複数個の第2の半導体材料を拡散接合で一体とし、前記第1及び第2の半導体材料の方位が、前記第1及び第2の光軸に垂直な方向に同一で、かつ、向きが交互に逆になるように配置された半導体疑似位相整合素子としたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラへルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

12

10 【0081】この発明の請求項12に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、請求項11において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、テラヘルツ領域で透明な材料としたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0082】この発明の請求項13に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、請求項12において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、GaPとしたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【0083】この発明の請求項14に係る固体光源装置は、以上説明したとおり、請求項12において、前記半導体擬似位相整合素子の前記第1及び第2の半導体材料を、GaAsとしたので、狭線幅特性を維持しつつ高出力かつ高効率なテラヘルツ波発生を容易かつ確実に実現できるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1に係る固体光源装置の構成を示す図である。

【図2】 非線形波長変換素子での波長変換光強度を示す模式図である。

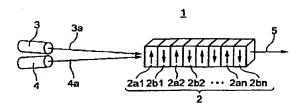
【図3】 GaPの屈折率の波長依存性を示す図である。

【図4】 コヒーレンス長の計算結果を示す図である。

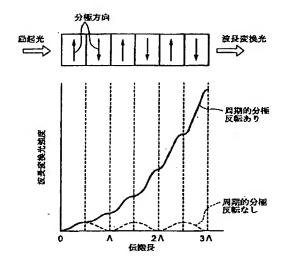
【図5】 従来の固体光源装置の構成を示す図である。 【符号の説明】

1 固体光源装置、2 半導体擬似位相整合素子、3 第1の励起レーザ光源、3 a 波長 λ 1 のレーザ光、4 第2の励起レーザ光源、4 a 波長 λ 2 のレーザ光、 5 波長 λ 3 のテラヘルツ光。

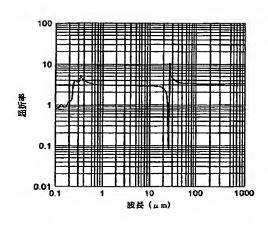
【図1】



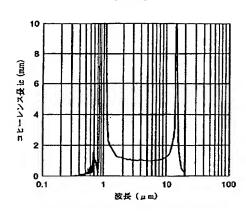
【図2】



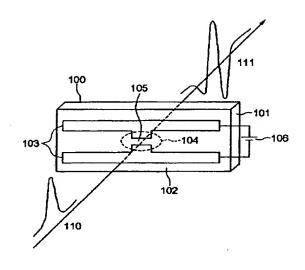
【図3】



【図4】



【図5】



フロントページの続き

(72)発明者 庄司 一郎

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38番地 岡崎国立共同研究機構分子科学研究所內

(72) 発明者 平等 拓範

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38番地 岡崎国立共同研究機構分子科学研究所内

(72) 発明者 栗村 直

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中38番地 岡 崎国立共同研究機構分子科学研究所内

F ターム(参考) 2K002 AB12 BA03 CA13 DA06 DA11 EA05 EA07 EA27 HA21 5F072 AB01 AB02 AB15 JJ20 KK11 QQ04 YY11 YY15